

**Renishaw** 宣布推出適用於 **REVO®** 多感應器系統的全新非接觸式影像測頭

Renishaw 隆重宣布推出搭配三次元量床 (CMM) 上的 REVO 5 軸量測系統使用的新視覺量測測頭 (RVP)。RVP 可藉由對現有接觸式觸發新增非接觸式檢測、高速接觸掃描和系統的表面粗糙度量測功能，以增加 REVO 的多感應器功能。

對於特定應用來說，非接觸式檢測具備的優點，明顯勝過傳統的接觸測頭量測技術。佈滿 0.5 mm 小孔 的金屬薄板工件或元件，以及不適合接觸量測的工件，皆能以 RVP 系統進行完整的檢測。藉由運用 REVO 測頭所提供的 5 軸運動及無限定位，RVP 能夠大幅提昇產能、改善 CMM 的功能。

RVP 系統是由一個測頭和許多能自動與所有其他可用 REVO 測頭選項互換的模組所組成。此外，它能自動將多個感應器的資料，參照至共同的基準。如此的高彈性代表您可以選擇最適合的工具，以便在單一 CMM 平台上檢測多種廣泛的要素。

在使用 RVP 時，工件照明是由每個模組內的整合式程式控制 LED 燈提供。使用背光與定製工件夾持工件的組合，也加強了背景的功能。

RVP 系統是由與 REVO 相同的 I++ DME 相容通訊介面所管理，並由 Renishaw 的 MODUS™ 量測軟體提供完整的使用者功能。新的 MODUS 視覺軟體功能，包括 RVP 配置、提供應用程式專屬選項的影像處理，以及可供檢閱和進一步分析的自動影像儲存功能。

全球各地的訪客可在 2015 年 10 月 5 日－10 日期間至 EMO 2015 第 5 廳D15 Renishaw 攤位，參觀全新 RVP 系統展示。

如需瞭解詳情, 請造訪 www.renishaw.com.tw/cmm。

結束